

# CONTENTS

<b>Nosov Yu. R., Smetanov A. Yu.</b> <i>On the Way in Nanoelectronics</i> . . . . .	2
<b>Galoushkov A. I., Pogalov A. I., Saurov A. N.</b> <i>Simulation of Vibroresonance Nanoelements for Ultrasensitive Devices of the Control of Mass</i> . . . . .	8
<b>Vavilov V. D., Glazkov O. N.</b> <i>The Mathematical Error Model and Static Equipment for the MEMS-Accelerometers</i> . .	13
<b>Belyanin A. F., Samoylovich M. I., Dzbanovskiy N. N., Pashchenko P. V., Timofeev M. A.</b> <i>Formation of Nanostructured Films and Layer Structures Iridium and Polycluster Diamond</i> . . . . .	16
<b>Bulygina E. V.</b> <i>Electrochemical Filling of Metals into Opal Matrix Pores</i> . . . . .	31
<b>Zaitsev N. A., Pastuhova Yu. M.</b> <i>The Behavior Model of Electrons in Ferroelectric Structure</i> . . . . .	43
<b>Teplova T. B.</b> <i>Investigation of Possibility of Treatment of an Electronic Engineering Materials in a Quasi Plastic Mode for Perfection of Quality of the Treated Surface</i> . . . . .	45
<b>Alexenko A. G., Balan N. N., Volkov Yu. A.</b> <i>About Dynamical Behavior of MEMS Structures in Pull-in Effect Occurrence</i> . . . . .	47
<b>Adamov D. Yu., Matveenko O. S.</b> <i>CMOS-Structure Development for Nanometer Technology</i> . . . . .	53
<b>Belozubov E. M., Belozubova N. E.</b> <i>Improvement in Vibration Temperature Stability of Thin-Film Sensors with Microelectromechanical Structures</i> . . . . .	63
<b>Kozyrev V. V.</b> <i>Development of the Mechatrone Modules with High Resolution for Nanotechnologies</i> . . . . .	67
<b>Soborover E. I., Kryazhev S. A.</b> <i>A Design of Bi-Functional Acoustic and Optic Sensor Cell for Nanolayers Physical and Medical Investigations ("Lab-on-Chip" Technology). Part 1. A Cell Construction Combined Surface Acoustic Wave and Light Reflection/Diffusion Measurements</i> . . . . .	70

## For foreign subscribers:

*Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)*

*The journal bought since november 1999.*

*Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev*

**ISSN 1813-8586.**

**Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.**

**E-mail: nmst@zknet.ru; http://www.microsystems.ru**

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромынский пер., 4/1. Телефон редакции журнала **(495) 269-5510. E-mail: nmst@zknet.ru**

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.  
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер *T. N. Погорелова*. Технический редактор *E. M. Патрушева*. Корректор *O. A. Шаповалова*

Сдано в набор 21.12.2007. Подписано в печать 25.01.2008. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 11,18. Заказ 83. Цена договорная

Отпечатано в ООО "Подольская Периодика", 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 15